

IV 表面計測評価システムの開発

- IV.1 STM-AES・XMA(Scanning Tunneling Microscopy – Auger Electron Spectroscopy・X-ray Micro Analysis)の開発
- IV.2 レーザー光散乱法によるナノメートルオーダーの微粒子計測および表面評価システムの開発
- IV.3 微小突起をプローブとした走査型近接場光学顕微鏡の開発